

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司*

(於百慕達註冊成立並於開曼群島存續之有限公司)

(股份代號：650)

半導體設備業務發展的進展

本公告由普達特科技有限公司*（「本公司」）自願作出，以向本公司股東及有意投資者提供有關本公司最新業務發展的資料。

茲提述本公司日期為二零二五年十月二十八日的公告（「該公告」），內容有關半導體設備業務的發展情況。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

半導體清洗設備成功交付客戶

本公司已成功向客戶交付一台12英寸高溫硫酸清洗設備（「該設備」）。該設備廣泛應用於28/14/7nm等先進製程的關鍵清洗工藝，市場目前主要由海外設備供應商壟斷。本公司研發的該設備，經過前期測試驗證，在技術性能方面均達到對標海外設備，且具備國內領先、國際一流的高溫控制能力，可覆蓋至190 °C的高溫硫酸清洗工藝。同時，該設備具備集成化與兼容性設計，並採用靈活的應用配置，可為客戶提供更具綜合競爭力的解決方案。

此外，本公司近期已成功向4家客戶交付5台單片晶圓清洗設備，包括：向一家12英寸晶圓代工廠客戶，成功交付一台OCTOPUS設備（「OCTOPUS設備」），用於28nm製程的關鍵清洗道次；向一家12英寸高性能模擬與功率器件客戶，成功交付一台OCTOPUS設備與一台CUBE設備（「CUBE設備」）等。上述成功交付的訂單

中，有兩台設備訂單為來自現有客戶的重複訂單。本公司亦獲得一台OCTOPUS設備重複訂單，該設備即將進行交付。上述訂單的收入均暫未確認。據董事會經做出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，該等客戶及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

未來，本公司將繼續致力於完成該等半導體清洗設備的訂單交付與驗收，並充分發揮本公司技術團隊在半導體濕法技術方面的優勢，繼續擴大高質量半導體客戶在關鍵應用領域對本公司設備的採用。

一般事項

設備交付項下擬進行的交易並無構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章項下本公司的須予公佈交易。本公司將適時另行刊發公告(如需)。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
普達特科技有限公司*
主席兼首席執行官
劉二壯

香港，二零二六年二月十一日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名為執行董事，即劉二壯博士(主席)、譚嶧先生及劉知海先生；兩名為非執行董事，即曹霄輝先生及林鈺凱先生；及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、周承炎先生及王國平先生。

* 僅供識別